



Copyright © 2018 Adenso.Solutions. All rights reserved. This document is the property of Adenso.Solutions. It is intended for internal use only. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Adenso.Solutions.

Adenso.Solutions
FOUF300 VACUUM LOAD PORT
 - direct wafer 300 loading
 into vacuum environment
 - no atmospheric handling necessary
 - saves a lot of floor space & costs
 solutions you need

www.waferhandling.solutions

Positionstoleranz / tolerances of location ☐ Bohrungen / holes 0,1 mm ☐ Gewinde / threads 0,1 mm ☐ Passungen / fits 0,01 mm	Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715 $+0,3$ $+0,1$ $-0,1$	Allgemertoleranz nach DIN ISO 2768 Längen und Winkelmaß m Form und Lage Allg.-Teil Schweißkonst. nach DIN ISO 2768 Längen und Winkelmaß m Form und Lage	Prüfnormen nach DIN 466-11 Toleranzgrundsatz nach ISO 8015 Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindung) DIN EN ISO 5817 c
projection ISO 128 - method 1 	Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302 Vakuum-Dichtflächen keine Rillen und Riefen quer zum Dichtungsverlauf zulässig Dichtfläche Rz 6,3	Maßstab: 1:12 Halbzeug:	Masse: - Material/Oberfläche:
Datum Name Gezeichnet 08.08.2018 BC Freigegeben		Benennung WHM330X Wafer Handling Module	
Status Änderungen Datum Name 330-010000-88.dwg		Zeichnungsnr. 330-010000-00 Revision 00 1 / 1 A2	
Kopie kann vom Maßstab abweichen. Copy may be not to scale.		Ersatz für: Ersatz durch:	

state of the art needed cleanroom space

Adenso FOUF300 VAC-LoadPort

minimum footprint

state of the art vac load lock gate valve

atmospheric handling

FOUF300 standard load port